# [研究論文] KIT-6 をテンプレートとしたメソポーラス酸化 チタンの合成過程 一分析電子顕微鏡システム利用 研究成果、その XXV (3)—

伊藤友貴<sup>1</sup>·丹羽紘一<sup>1</sup>·伊熊泰郎<sup>1</sup>

1 応用化学科

Observation of mesoporous titanium dioxide synthesis process —Research works accomplished by using Electron Microscope System: XXV (3)—

Yuuki ITO<sup>1</sup>, Koichi NIWA<sup>1</sup>, Yasuro IKUMA<sup>1</sup>

## Abstract

Using amorphous mesoporous  $SiO_2$  (KIT-6) as a template, mesoporous  $TiO_2$  powder was synthesized by exchanging Si for Ti. The process was examined by TEM and X-RD. Just after the exchange reaction, the microstructure of  $TiO_2$  was almost the same as that of mesoporous  $SiO_2$  (KIT-6). The distance between the neighboring mesopores was slightly expanded. It was still in amorphous phase. Once the powder was heated to  $600^{\circ}$ C,  $TiO_2$  crystallized to anatase phase. The microstructure of crystalline phase was similar to that of mesoporous  $SiO_2$  with smaller distance between the neighboring pores. The shape of pore was not as clear as amorphous  $SiO_2$ .

Keywords: mesoporous TiO<sub>2</sub>, template method, mesoporous SiO<sub>2</sub>, anatase TiO<sub>2</sub>

## 1. はじめに

金属酸化物を合成する場合、その金属イオンを含む水溶 液に沈殿剤を導入し、沈殿をろ過、か焼して合成する。こ の方法の生成物(沈殿をか焼したもの)は表面積が5~20 m²/g(酸化ジルコニウムの場合<sup>(1)</sup>)の通常の粉末になる。 一方、微構造を制御した粉末、特に高比表面積メソポーラ ス粉末は触媒などの用途が考えられるため、その合成法を 確立することは重要である。界面活性剤を用いて合成した メソポーラスシリカをテンプレートとして、高比表面積金 属酸化物を合成する手法<sup>(2)</sup>(テンプレート法)を用いて Tuysuz ら<sup>(2)</sup>は Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub> 系酸化物を合成した。本論文の著者の 何人かは、Tuysuz らと類似の手法を用いてメソポーラス 酸化チタンを合成した<sup>(3)</sup>が、その合成過程の変化は良く分 かっていない。そこで、本研究ではテンプレート法による メソポーラス酸化チタン合成過程の一部を理解すること を目的とした。

## 2. 実験方法

チタンのアルコキシドは水との反応が非常に速いため、

これを用いた反応を制御してメソポーラス酸化チタンを 合成することは困難である。一方、ケイ素のアルコキシド は水との反応が遅いので、メソポーラス酸化ケイ素を合成 する方法は確立<sup>(4)</sup>している。本研究では、3次元の秩序構 造をとる KIT-6 (SiO<sub>2</sub>である)を合成<sup>(4)</sup>し、その Si を Ti で置換する手法を用いて、メソポーラス酸化チタンを合成 することにした。

界面活性剤と TEOS (テトラエトキシシラン)を用いて、 KIT-6 (未か焼)を合成した<sup>(4)</sup>。これを 540℃でか焼する ことで、KIT-6 (540℃か焼後)とした。これがシリコンテ ンプレートである。次にこのシリコンテンプレート粉末と チタンイソプロポニドを混合し、90℃で 24 h 加熱するこ とにより、Si と Ti の置換反応を進行させた。さらに、150℃ で 24 h 乾燥した。これを TiO<sub>2</sub> (未か焼)とする。次に、 これを酸素気流中、600℃で 5 h か焼して TiO<sub>2</sub> (600℃か 焼後)を作製した。これら4 種類の試料を粉末X線回折 (X-RD)と透過型電子顕微鏡(TEM)で評価した。

X-RDにはRigakuのRINT 2500VHFを用い、管電流200 mA、 電圧50 kV、スキャンスピード4.0°/minの条件で測定し た。TEMにはJEOLのJEM2100を用い、加速電圧200 kV、 倍率40,000~80,000倍の条件で観察した。

## 3. 実験結果と考察

本研究で得られた4種類の試料の TEM 観察結果を図1 に示す。KIT-6(未か焼)(図1(a))は10 nm以下の粒子 の集合体である。X線回折で調べた結果、何のピークも得 られなかったので、非晶質の微粒子が集合した粉末である。 これを 540℃でか焼したものが KIT-6 (540℃か焼後)でそ の TEM 写真を図1 (b) に示す。図から、100~200 nm の粒 子の集合体であることが分かる。すなわち、KIT-6 (540℃ か焼後)はKIT-6(未か焼)より粒成長した。この粒子には 黒い線状部分と白い線状部分が交互に存在し、メソポーラ スであると言える。なお、この線状部分の長さは最大でも 200 nm 位であるが、この写真からは3次元の秩序構造で あることを確認できない。それでも、きれいな線状部分が あるので、KIT-6(未か焼)より結晶性は高くなったと考え られる。しかし、KIT-6 (540℃か焼後)のX線回折図 (図 2の(a))はこの試料が結晶質でなく、非晶質であること を示している。2 θ=23°付近に幅広いピークが見られるこ とから、第1近接原子の距離はほぼ一定であるが、第2近 接原子以後は一定ではないと思われる。









(c)



(d)

図1. 試料の TEM 画像。(a) KIT-6 (未か焼),(b) KIT-6 (540℃か焼後),(c) TiO<sub>2</sub> (未か焼),(d) TiO<sub>2</sub> (600℃か 焼後)



図2. X-RD 結果。(a) KIT-6 (540℃か焼後),(b) TiO<sub>2</sub> (未 か焼),(c) TiO<sub>2</sub> (600℃か焼後) KIT-6 (540℃か焼後)のSiをTiで置換したTiO<sub>2</sub> (未か 焼)は図1 (c)に示すとおり、KIT-6 (540℃か焼後)とほぼ 同じような微構造である。つまり、KIT-6 (540℃か焼後)とほぼ 同じような微構造である。つまり、KIT-6 (540℃か焼後) の構造を維持したままSiがTiに置換わったようである。 類似の系のEDXで示された<sup>(5)</sup>ように、Siが数10%残留し ている。X線的には図2の(b)に示すとおり、結晶性は KIT-6 (540℃か焼後)とほぼ同じで悪く、幅広いピークが 2 $\theta$ = 23°から21°に移動した。つまり、第1近接原子の 距離が長くなった。このTiO<sub>2</sub> (未か焼)を600℃でか焼し たTiO<sub>2</sub> (600℃か焼後)は図1 (d)に示す微構造で、TiO<sub>2</sub> (未か焼)より白い線状部分弱くなった。X線回折の結果

(図2の(c)) は明らかに結晶性が高いことがわかる。これらのピークは全てアナターゼ型 TiO<sub>2</sub>のピークに対応する。図2の(c)を良く観察すると、2 $\theta$ =15°~30°付近にブロードなピークがあり、少し非晶質な成分が残存していると思われる。

図1(b)のKIT-6(540℃か焼後)と図1(c)のTiO<sub>2</sub>(未か 焼)はほぼ同じように見え、図1の(d)のTiO<sub>2</sub>(600℃か焼 後)では黒い線状部と白い線状部の区別が弱くなったよう に思える。この白い線状部は試料の厚さが薄いのでメソ孔 があいている部分と思われる。この白い部分と隣の白い部 分の間の長さを測定した結果を表1に示す。この表の値は 同一試料で100ヶ所のメソ孔間距離を測定した平均値で ある。KIT-6(未か焼)ではメソ孔が認識できないので、測 定できなかった。KIT-6 (540℃か焼後)のメソ孔間距離 (8.4 nm)は文献値(4~12 nm)<sup>(4)</sup>と比べて妥当な値である。 これを構成する Si を Ti で置換した TiO<sub>2</sub>(未か焼)では、 メソ孔間距離は10.2 nm と少し大きくなった。これは、Si<sup>4+</sup> のイオン半径 0.041 nm より Ti<sup>4+</sup>のイオン半径 0.068 nm が 大きいことに関係している。つまり、メソ孔の周囲の骨格 構造が大きくなったため、相対的にメソ孔が大きくなった ものと考えられる。Ti0,(600℃か焼後)のメソ孔間距離が 短くなったのは結晶化が進行し、Ti-0の原子間距離が短 くなったからで、焼結が進行したことも影響している。

- X1, 两种9个为16间距离99例定值	
試料	平均メソ孔間距離(nm)
KIT-6 (未か焼)*	_
KIT-6(540℃か焼後)	8.4
TiO <sub>2</sub> (未か焼)	10.2
TiO <sub>2</sub> (600℃か焼後)	7.1

表1. 試料の平均メソ孔間距離の測定値

\* メソ孔が観察されなかったのでメソ孔間距離は測定し ない

## 4. まとめ

メソポーラス酸化ケイ素 KIT-6の Si を Ti で置換するこ とでメソポーラス酸化チタンを合成する方法において、物 質の微構造変化を TEM で、結晶構造変化を X-RD で調べた。 その結果、メソポーラス酸化ケイ素(KIT-6(540℃か焼 後)) は平均メソ孔間距離が 8.4 nm の構造で、非晶質であ った。この Si を Ti で置換すると、微構造も非晶質状態も 維持したまま Ti に置換わることが明らかとなった。Ti<sup>4+</sup> のイオン半径が Si<sup>4+</sup>のイオン半径より大きいため、置換直 後の TiO<sub>2</sub> (未か焼)のメソ孔間距離は大きくなったが、非 晶質のままであった。これを 600℃に加熱した TiO<sub>2</sub> (600℃ か焼後)は結晶で、メソポーラスな状態を維持していたが、 メソ孔の形が小さくなった。

#### 参考文献

[1] Y. Ikuma, K. Komatsu, and W. Komatsu, *Adv. Ceram.*, 24, 749-758 (1988).

[2] H. Tuysuz, E. L. Salabas, E. Bill, H. Bongard, B. Spliethoff, C. W. Lehmann, and F. Schuth, *Chem. Mat.*, <u>24</u>, 2493-2500 (2012).

[3] S. Anandan, Y. Ikuma, K. Kakinuma, and K. Niwa, NANO, <u>3</u> [5] 367-372 (2008).

[4] F. Kleitz, S. H. Choi, and R. Ryoo, *Chem. Commun.*, 2003, 2136-2137 (2003)..

[5] 篠川寛、神奈川工科大学応用化学科卒業論文(2014 年3月).